科学研究**費**補助金研究成果報告書

平成 22 年 6 月 28 日現在

研究種目:基盤研究(C)研究期間:2007~2009課題番号:19560039

研究課題名(和文)干渉露光による3次元フォトニック結晶欠陥導波路の形成に関する研究

研究課題名(英文)Study on fabrication of defect waveguide in three-dimensional photonic crystals by holographic lithography

研究代表者

小野 雄三 (ONO YUZO) 立命館大学・理工学部・教授 研究者番号:90319492

研究成果の概要(和文):

干渉露光法で形成した3次元フォトニック結晶中に欠陥を導入して導波路とする光導波路の形成方法を提案し、実証した。2光束干渉の3重露光法を提案開発し、この手法で面心立方格子および、これを1/4周期ずらせて重畳することでダイヤモンド構造結晶も形成した。干渉露光で形成した3次元フォトニック結晶の透過率解析を実効屈折率法で行い、波長に対する透過率の曲線中に、フォトニック結晶の特徴であるバンドギャップが出現したことを確認した。

研究成果の概要 (英文):

Fabrication method of waveguides where embedded defects in three-dimensional photonic crystals function as waveguides fabricated by holographic lithography was proposed and demonstrated. Fabrication method of three-dimensional photonic crystals by triple-exposure of two-beam interference fringes was also proposed and developed. By using this method face-centered cubic lattice and diamond structure crystal which consists of two face-centered cubic lattices which are shifted in a quarter lattice constant were fabricated. Transmission analysis of three-dimensional photonic crystal fabricated by holographic lithography was done by effective medium theory. As a result, photonic band-gap was appeared in the transmission versus wavelength curve.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2007 年度	3,300,000	990,000	4290,000
2008 年度	300,000	90,000	390,000
2009 年度	300,000	90,000	390,000
年度			
年度			
総計	3,900,000	1,170,000	5,070,000

研究分野:工学(応用光学)

科研費の分科・細目:応用物理学・工学基礎、細目:応用光学・量子光工学

キーワード:光エレクトロニクス、フォトニック結晶、ホログラフィック・リソグラフィー、

干涉露光、光導波路

1.研究開始当初の背景

3 次元フォトニック結晶の形成方法として

は、微細加工プロセスにより1次元格子を交 互に交叉して積層する wood-pile 型と、自己 配列により微小球を配列させた opal 型が多 いが、前者では加工精度、加工工数からの制 約から、また後者では配列の再現性・信頼性 が高くないことから、いずれもフォトニック 結晶の特性を十分発露したものは得られて いない。一方、最近バイアススパッタリング 法や、多光子吸収による3次元マイクロファ ブリケーション法、多光束干渉露光法が提案 されて、フォトニック結晶の特性が発露する ようになってきた。しかし、まだ、積層する 層数や、結晶の大きさに制約があり、応用を 視野に入れるところまでは来ていない。本研 究の提案者も、4 光束干渉露光法と X 線リソ グラフィー法を立ち上げてきた。特に前者に ついては、理論面も十分構築してきた。しか し、4 光束ということで光学系が複雑で形成 できる結晶系に制限がある。この研究の過程 で、最も単純な2光束干渉で感光体を2軸に 回転して多重に露光することで、3 次元フォ トニック結晶を形成できるという着想を得、 特許出願した。2 光東干渉は偏光も完全に同 一に出来、変調度も 100%に出来る上、光パワ ーロスも少ないので、大型でフォトニック原 子形状のクリアな結晶形成が期待できる。

-方、フォトニック結晶中に周期構造を壊 した欠陥導波路を形成する方法としては、多 光子吸収を用いて局部的に周期構造を破壊 することが提案されているが、導波路として の成果は出ていない。最近、3次元フォトニ ック結晶の多光束干渉形成法において、ネガ 型フォトレジスト層の表層を電子ビームで 露光して導波路パターンを硬化させ、その上 にさらに同じフォトレジストを塗布した後、 多光束干渉露光で全体を露光して3次元フォ トニック結晶を形成する方法が提案されて いる。本研究提案者は、これまでの4光束干 渉露光法の開発の過程で、感光体の波長特性 を改善してきた。すなわち、350~400nmで感 光特性が最適化された SU-8 フォトレジスト を長波長で露光出来るようにした。SU-8フォ トレジストは350nmより短波長で露光すると、 光吸収が大であるため、表層のみが露光され る。この特性を用いて、325nm を光源とする フォトリソグラフィーで導波路パターンを 表層に硬化形成し、その上にさらに同じフォ トレジストを塗布した後、350nm 以上の波長 を用いた2光束干渉露光の多重露光で全体 を露光して欠陥導波路が埋め込まれた3次 元フォトニック結晶を形成する方法を着想 した。

本研究は、新規な方法として UV リソグラフィーと、2 光束干渉露光の多重露光を用いることで、層数や結晶の大きさを導波路に応用可能なものにしようとするものである。

2. 研究の目的

本研究の目的は、本研究の提案者の出願特許を基に、実用的な結晶サイズと量産性があり将来に於いて工業化の可能性のある、3次元フォトニック結晶の形成方法を実現するとともに、その光学デバイス応用としてこれに欠陥導波路の形成を実現することにある。

3.研究の方法

平成 19 年度の計画

- ・ 本方法では、高アスペクト比のネガ型フォトレジストとして、SU-8 フォトレジストを用いる。3 次元フォトニック結晶を干渉露光で形成する波長は感光特性から 350~400nm であることが必要なため、設備備品費にあげた、波長 363.8nm のアルゴンレーザを導入する。
- ・ 導入したアルゴンレーザを光源として、 現有の 4 光東干渉露光系を改造して、干渉 位置を変えることなく干渉角を容易に変更 できる 2 光東干渉露光系を構築する。これ は、3 回露光の途中で干渉角を変更しなけれ ばならないことも予想されるためである。 これとともに、2 軸で回転できる試料回転台 を設計・試作する。(このため、光学部品を 購入する)
- · 上記 SU-8 フォトレジストに対する、プロセス条件、特に 3 重露光におけるプロセス条件と問題点を把握する。
- ・2 光東干渉露光の3 重露光による3 次元フォトニック結晶形成の理論解析を進め、 形成できる結晶構造を明らかにする。これまで、4 光東干渉露光での形成の理論を構築しているので、比較的容易に新規理論を構築出来ると予想している。
- 上記理論結果について、成果発表する。 (米国 OSA 学会、または SPIE 学会を予定し、 海外旅費と参加費を経費計上している)
- 一方、欠陥埋め込み導波路の形成方法として、 He-Cd レーザ(325nm)によるパターン直描、 He-Cd レーザ(325nm)を光源とするフォトマスク露光、 電子ビーム直描、の3つの方法により、フォトレジスト

の表層に導波路を形成できるようにする。 使用を予定している SU-8 フォトレジストは 波長 350nm 以下では吸収が極めて大きいた め、照射光はレジスト表層で吸収してしま い、表層のみにパターンを形成できる。し かし、導波路としての深さをコントロール するには波長の選択をしなければならない。 このため、最も確実に深さ制御のできる電 子ビーム露光も第3候補とする。

上記3方法のプロセス条件を把握する。 (このため、感光材料(フォトレジスト) を購入する)

平成 20 年度以降の計画

- · 前年度得られた材料・プロセス構成で欠陥導波路埋め込み3次元フォトニック結晶の形成を試みる。
- 完全バンドギャップによる導波を目的に、ダイヤモンド構造の3次元フォトニック結晶の形成を試みる。干渉光の位相を1/4波長シフトして多重露光するために、光学系に1/4波長板を導入することで実現できる見込みである。
- ・ フォトニック結晶の透過・反射特性が測定出来る実験系を整え、形成したフォトニック結晶の評価方法を確立する。現有の分光光度計のビームをマスキングするか、顕微分光に相当する光学系を簡易的に取り付ける。
- ・ フォトニック結晶の特性の内、特に光学素子への応用に重要な、分散特性等の発露の程度を把握することにより、結晶性を高める方法を実験的に研究し、各種の格子構造について形成方法を確立する。
- · 2光東干渉の3回露光方式の理論を完成させる。これにより得られる種々の格子構造に関して、実験的に形成を試みる。
- ・ フォトレジストでは屈折率が低いため、 バンドギャップ等の特性が十分に発露しな いことも予想される。そこでフォトニック 原子と背景誘電体との間の屈折率差を大き くするために、ゾル・ゲル法による材料置 換を検討する。
- ・ 結晶の大きさを拡大する方法の検討を行うと共に、本方法による生産性を向上する条件、方法について実験的に検討し、導波路デバイスへの応用を目指す。
- ・ 欠陥導波路埋め込み3次元フォトニック 結晶の形成について、成果発表する。(欧 州EOS学会、またはSPIE学会を予定し、海外 旅費と参加費を経費計上している。

4.研究成果研究の主な成果

- ・ YVO4 レーザの 3 逓倍波レーザ (パルス発振、355nm)を導入したが、コヒーレンス長が約 2mm と短く、レーザ結晶を YAG にしても約 3mm とあまり改善が見られず、共振器中にエタロンを挿入することで 7mm にできたが出力が200mWから60mWに低下してしまった。製作実験は出力が大きく露光時間を短縮できる YVO4 で実施し、所望の結晶を製作できた。
- ・ 欠陥導波路の埋め込み方法として提案している、高吸収波長である 325nm 波長のHe-Cd レーザでのパターン描画の実験を行い、描画後レジストの再塗布を行わず、2 光束干渉の 3 回露光でフォトニック結晶(面心立法格子)を作成した。電子顕微鏡では、描画された導波路部が盛り上がっているのが観察された。これは架橋反応時に周囲からモノマーを引き込んでいるためである
- ・プロセス条件では大きく進展した。1、2、3 回目で露光量を変えなければ各々の干渉 縞を一定に記録できないことがわかり、各 回の露光量を適正化した。フォトレジス トの現像が3次元の深い底面まで進ま ない問題に関しては、現像液とリンス 液を新しい液に交換して現像とリンス を数回繰り返すことで、改善された。
- ・ 2 光東干渉の3 重露光による3 次元フォトニック結晶形成の理論解析はほぼ完了し、14 種全てのブラベー格子構造が形成できる。
- ・ 2 光束干渉の 3 回露光方式により面心立 方格子および菱面体構造結晶を形成した。
- ・ ピエゾ素子でピストン駆動される反射鏡 を導入し、干渉計の一方の光路の位相を制 御できるようにした。これにより、ダイヤ モンド構造に加え、ウッドパイル構造も形 成できるようになった。
- ・ {1,1,1}型面心立方格子の露光配置で、2光束干渉縞を露光した後、一方の干渉光を /2位相シフトして再露光し、さらに感光体を回転することを3回繰り返し、合計6回の露光を重畳することでダイヤモンド構造を形成できた。
- ・ 干渉露光で形成した3次元フォトニック 結晶の透過率解析を実効屈折率法で行った 結果、透過率の波長依存性カープ中にフォ トニック結晶の特徴であるバンドギャップ が出現したことを確認した。

得られた成果の国内外における位置づけと インパクト

- ・ 2 光東干渉の 3 重露光による 3 次元フォトニック結晶形成方法の提案、理論証明、 実験的実証(菱面体構造結晶)は世界初。
- ・ 2 光束干渉の3 重露光にさらに位相シフトした2 光束干渉の3 重露光する手法でダ

イヤモンドライク結晶を形成したのは世界 初である。

- ・ 干渉露光法で形成した3次元フォトニック結晶中に欠陥導波路を形成できることを 実証したのは国内初で、新聞取材を受け、 掲載された。
- 干渉露光で形成した3次元フォトニック 結晶の透過率解析を実効屈折率法で行った 結果については国際学会で高く評価された。

今後の展開

- ・ 2 光東干渉の 3 重露光による 3 次元フォトニック結晶形成方法で 14 種類全ての格子構造が製作できるが、実証したのは面心立法、菱面体構造のみであり、今後 14 種類の実証を進める。
- ・ ダイヤモンドライク結晶が完全バンドギャップを持つフォトニック結晶に適しているので、今回開発した製法をさらにリファインして行く。
- ・ 大型結晶を製作するにはレーザのコヒーレンス長が製作する結晶サイズ程度必要であるが、これにはシード・インジェクション型 YAG レーザの 3 逓倍波レーザを用いることが肝要である。
- ・ 現在はフォトレジストを材料に欠陥埋め 込み導波路を形成しているが、大きなバン ドギャップを得るには屈折率の大きい材料 に置換することが得策であり、TiO2 等をゾ ル・ゲル法を用いて置換することを今後進 める。

5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 1件)

著者名:<u>小野雄三</u>、論文標題:3次元周期構造としてのフォトニック結晶、雑誌名:OPTRONICS、査読:無、巻:通巻No.318、発行年:2008、ページ:133-137.

[学会発表](計 5件)

発表者名: Masakazu Notsu and Yuzo Ono、 発表標題: Transmittance analysis of holographically fabricated photonic crystals by the effective medium theory、学会名等: 15th Microoptics Conference、発表年月日: 2009 年 10 月 27日、発表場所:未来館、お台場(東京). 発表者名: Yuzo Ono、発表標題: All fourteen Bravais lattices can be fabricated by two-beam holographic lithography、学会名等: OSA Optics and Photonics Congress 2009, Advances in Imaging, Digital Holography and Three-Dimensional Imaging、発表年月 日:2009年4月27日、発表場所:Vancouver, British Columbia (Canada).

発表者名:<u>小野雄三</u>、発表標題:干渉露光による3次元フォトニック結晶の形成、学会名等:次世代光学素子研究会、発表年月日:2009年2月27日、発表場所:大坂科学技術センター(大阪). 発表者名: Yuzo Ono and Takashi Ochi、発表標題: Fabrication of three-dimensional photonic crystals by two-beam holographic lithography、学会名等: EOS Topical meeting on Diffractive Optics 2007、発表年月日: 2007年11月23日、発表場所:Barcelona (Spain).

発表者名: Yuzo Ono and Takashi Ochi、 発表標題: Fabrication of three-dimensional photonic crystals by triple-exposure of two-beam interference fringes、学会名等: OSA Topical Conference on Nanophotonics 2007、発表年月日: 2007 年 6 月 19 日、 発表場所:杭州(中国).

[その他]

報道関連情報:2007年5月17日付日刊工業 新聞23面に「3次元フォトニック結晶 立 命館大が簡易製法、光通信デバイス量産の 道」と題して掲載された(2007年5月9日 日取材を受けた).

アウトリーチ活動情報:イノベーション・ジャパン 2007 - 大学見本市のナノテク・材料分野で「3次元フォトニック結晶の製造方法 - ホログラフィックリソグラフィーによるフォトニック結晶形成」と題して展示説明を行った(2007年9月12~14日).

ホームページ等:

http://www.ritsumei.ac.jp/se/re/onolab/

6.研究組織

(1)研究代表者

小野 雄三 (ONO YUZO) 立命館大学・理工学部・教授 研究者番号:90319492